

プラズマエレクトロニクス講習会					
回目	開催年	講演番号	月日	講師名	講演題目
32	2021		11月12日(金)		
32	2021	1		金子 俊郎	非平衡プラズマの生成と温度・エネルギー制御の基礎
32	2021	2		赤塚 洋	プラズマ計測技術の基礎・応用の最近の動向
32	2021	3		野尻 一男	ドライエッチング技術の進展と今後の展望
32	2021	4		板垣 奈穂	スパッタリング成膜技術の基礎と最新動向
32	2021	5		白井 直機	大気圧プラズマの基礎・応用技術の最新動向
32	2021	6		江利口 浩二	プラズマ誘起ダメージ機構の基礎とその評価手法
31	2020		10月20日(火)		
31	2020	1		八木澤 卓	プラズマ生成・制御技術の基礎と応用
31	2020	2		小川 大輔、中村 圭二	プラズマ診断技術の基礎と最新動向
31	2020	3		布村 正太	プラズマCVD 技術の基礎と最新動向
31	2020	4		土屋 智由	プラズマプロセスにより作製するMEMS デバイスの最近の動向
31	2020	5		酒井 道	プラズマプロセスと情報工学の融合
30	2019		11月12日(火)		
30	2019	1		重里 有三	反応性スパッタリングの基礎と応用展開
30	2019	2		稲田 優貴	プラズマの基礎と計測技術
30	2019	3		節原 裕一	非平衡プラズマ生成制御とプロセス
30	2019	4		登尾 一幸	産業応用に向けたプラズマ装置開発の現状
30	2019	5		深沢 正永	プラズマエッチングにおけるプラズマダメージ制御の最前線
29	2018		11月20日(火)		
29	2018	1		金子 俊郎	プラズマ生成制御(基礎から最新まで)
29	2018	2		佐々木 浩一	発光によるプラズマ診断
29	2018	3		浜口 智志	最先端プラズマプロセスのシミュレーション
29	2018	4		康 松潤	プラズマプロセス装置開発最前線
29	2018	5		篠田 和典	原子層エッチングプロセス
28	2017		11月15日(水)		
28	2017	1		中村 圭二	プロセスプラズマの計測・診断技術
28	2017	2		江利口 浩二	プラズマによるデバイスへのダメージ
28	2017	4		本田 昌伸	最先端エッチング技術ーALEおよびHARC加工技術ー
28	2017	3		野尻 一男	ドライエッチングの基礎
28	2017	5		唐橋 一浩	各種ビームを用いた表面反応解析
27	2016		11月18日(金)		
27	2016	1		根岸 伸幸	先端半導体におけるプラズマエッチング
27	2016	2		渡辺 隆行	熱プラズマによる有害物質分解
27	2016	3		小田 昭紀	プラズマシミュレーション
27	2016	4		古閑 一憲	プラズマ計測・診断ー反応性プラズマ中微粒子を心としてー
27	2016	5		堀 勝	プラズマの生成と基礎
26	2015		11月20日(金)		
26	2015	1		菅井 秀郎	プラズマプロセスの基礎と計測
26	2015	2		辰巳 哲也	半導体エッチング技術
26	2015	3		霜垣 幸浩	プラズマCVD技術とALD応用
26	2015	4		石川 健治	医療・バイオ応用プラズマ技術
25	2014		11月26日(水)		
25	2014	1		浜口 智志	プラズマプロセスの基礎と素過程
25	2014	2		佐々木 浩一	プラズマ計測と診断
25	2014	3		垣内 弘章	大気圧プラズマ技術と成膜応用
25	2014	4		水野 彰	プラズマを用いた環境クリーン化技術
25	2014	5		関根 誠	半導体ドライエッチング技術
25	2014	6		田中 潤一	プラズマエッチングプロセスの開発における数値解析の実用
24	2013		11月8日(金)		
24	2013	1		白藤 立	プラズマの基礎とCVD技術
24	2013	2		大矢 欣伸	装置、計測とドライエッチング技術
24	2013	3		江利口 浩二	先端プロセスとプラズマダメージ
24	2013	5		安田 哲	設備管理(EES/FDC等)技術
24	2013	4		高木 茂行	マルチスケールシミュレーションによる半導体装置・プロセス
24	2013	6		一木 隆範	プラズマを応用したナノバイオ技術
23	2012		11月14日(水)		
23	2012	1		堀 勝	プラズマの生成と制御・装置
23	2012	2		野尻 一男	表面反応の制御とドライエッチング技術
23	2012	3		豊田 浩孝	プラズマ計測/モニタリング技術
23	2012	4		八木澤 卓	シミュレーション技術
23	2012	5		野崎 智洋	大気圧プラズマとその応用
23	2012	6		土山 洋史	設備管理(EES/FDC等)技術
23	2012	7		木下 啓藏	DPS2011に見るプラズマ技術の新展開
22	2011		10月27日(木)、28日(金)		
22	2011	1		中村 圭二	プラズマ計測:電氣的計測
22	2011	2		山田 英明	プラズマシミュレーション
22	2011	3		佐々木 浩一、栗原 一彰	プラズマ計測:電氣的計測+実演
22	2011	4		八木澤 卓	プラズマの生成・制御
22	2011	5		北野 勝久	LF マイクロプラズマジェットを用いた大気圧低温プラズマの
22	2011	6		安部 隆	MEMSにおけるプラズマエッチング技術の展開

22	2011	7		布村 正太	プラズマによるグリーンイノベーション
22	2011	8		一木 隆範	プラズマによるライフイノベーション
21	2010		10月28日(木)、29日(金)		
21	2010	1		菅井 秀郎	プラズマの生成・制御
21	2010	2		田中 正明(文 松永 史彦)	プラズマシミュレーション
21	2010	3		佐々木 浩一	プラズマ計測:光学的計測
21	2010	4		豊田 浩孝	プラズマ計測:電氣的計測
21	2010	5		江利口 浩二	プラズマプロセス表面過程とデバイスダメージ
21	2010	6		垣内 弘章	大気圧プラズマCVDによる高速成膜
21	2010	7		栃久保 文嘉	気体・液体プラズマによるクリーン化技術
21	2010	8		大場 隆之	WOWを用いた三次元積層技術
20	2009		10月29日(木)、30日(金)		
20	2009	1		節原 裕一	プラズマの生成・制御
20	2009	2		中村 圭二	プラズマ計測 -電氣的手法を中心として-
20	2009	3		宮崎 誠一	プラズマによる薄膜形成技術
20	2009	4		江利口 浩二	プラズマによるエッチング技術
20	2009	5		白谷 正治	プラズマ計測:光学的計測
20	2009	6		奥村 智洋	大気圧プラズマの生成と応用
20	2009	7		永津 雅章	プラズマの医療・バイオ応用
19	2008		10月30日(木)、31日(金)		
19	2008	1		菅井 秀郎	プラズマの生成・制御
19	2008	2		赤塚 洋	プラズマ計測
19	2008	3		田中 正明	プラズマシミュレーション
19	2008	4		佐々木 敏明	プラズマによる薄膜形成技術
19	2008	5		林 俊雄	プラズマによるエッチング技術
19	2008	6		湯浅 基和	大気圧プラズマの応用
19	2008	7		秋山 秀典	液相プラズマの応用
18	2007		11月1日(木)、2日(金)		
18	2007	1		美船 章人	量産応用最先端プラズマ解析技術
18	2007	2		中村 圭二	プラズマ生成と電子状態のIn-situ計測
18	2007	3		中野 俊樹	光学手法を用いたプラズマ計測
18	2007	4		島田 学	In-situ パーティクル計測
18	2007	5		関根 誠	2035年のプラズマ技術
18	2007	6		江利口 浩二	シリコン加工モデリング
18	2007	7		八木澤 卓	絶縁膜加工モデリング
18	2007	8		田中 正明	実用シミュレーション技術
18	2007	9		森川 泰宏	MEMS応用プラズマ技術
18	2007	10		齋藤 永宏	バイオチップ開発のためのプラズマアクティベーション
17	2006		10月5日、6日		
17	2006	1		佐々木 浩一	プラズマの計測・実践的発光分光
17	2006	2		永津 雅章	プラズマの生成と制御
17	2006	3		寺嶋 和夫	大気圧プラズマ技術:マイクロからメートルまで
17	2006	4		白藤 立	プラズマCVD の気相・表面反応
17	2006	5		高橋 直樹	真空生成・計測・制御技術
17	2006	6		伊澤 勝	プラズマ加工技術とモニタリング
17	2006	7		一木 隆範	プラズマデバイスの基礎と μ TAS, バイオ応用
16	2005		10月27日、28日		
16	2005	1		白谷 正治	プラズマの計測・実践的発光分光
16	2005	2		板橋 直志	プラズマの生成と制御方法
16	2005	3		粟野 祐二	カーボン配線技術
16	2005	4		斧 高一	反応性プラズマ中の気相・表面反応
16	2005	5		藤原 伸夫	プラズマ加工技術
16	2005	6		佐々木 実	プラズマ技術と光集積MEMS
16	2005	7		水野 彰	大気圧プラズマ技術とその応用
15	2004		10月14日(木)、15日(金)		
15	2004	1		進藤 春雄	プラズマの生成と制御法
15	2004	2		堀 勝	反応性プラズマ中の気相・表面反応
15	2004	3		豊田 浩孝	プラズマの計測・モニタリング手法
15	2004	4		高橋 千春	フォトニック結晶とプラズマプロセス
15	2004	5		小野 崇人	MEMSとプラズマプロセス
15	2004	6		林 康明	プラズマCVDによる配向カーボンナノチューブ成長
15	2004	7		行村 建	プラズマイオン注入体積プロセスとその応用
15	2004	8		葛本 昌樹	大気圧プラズマと環境ビジネス
14	2003		9月11日、12日		
14	2003	1		岡崎 幸子	大気圧プラズマプロセスの可能性
14	2003	2		小駒 益弘	大気圧プラズマ生成と応用技術
14	2003	3		寒川 誠二	ウェハーエッチングプラズマシステムの設計とプロセス構築
14	2003	4		寺嶋 和夫	高気圧プラズマ装置とプロセス構築
14	2003	5		浜口 智志	シミュレーションによるプロセス・システム構築
14	2003	6		一木 隆範	バイオMEMS, μ TAS 応用プラズマの装置とプロセス設計
13	2002		11月11日(月)、12日(火)		
13	2002	1		中村 圭二	プローブ計測法の実際と解析手法
13	2002	2		佐々木 浩一	発光分光計測技術の実際と解析手法
13	2002	3		堀 勝	吸収分光計測技術の実際と解析手法

13	2002	4		川田 博昭	インピーダンス計測とプラズマ特性解析への応用
13	2002	5		藤原 裕之	実践的エリプソメトリー計測・解析技術
13	2002	6		村岡 浩一	実践的XPS計測と解析技術
13	2002	7		辰巳 哲也	エッチングプロセス構築手法
13	2002	8		霜垣 幸浩	CVD プロセス構築手法
12	2001		12月17日(月)、18日(火)		
12	2001	1		白井 肇	シリコンプラズマCVDにおける現状と今後の課題
12	2001	2		辰巳 徹	次世代極薄ゲート絶縁膜の材料と形成方法
12	2001	3		白藤 立	Low-k 膜のCVD
12	2001	4		浜口 智志	プロセスシミュレーション
12	2001	5		三重野 哲	プロセスプラズマの状態を知る(プラズマ診断)
12	2001	6		庭野 道夫	半導体表面・界面反応の赤外分光高感度モニタリング
11	2000		11月6日(月)、7日(火)		
11	2000	1		豊田 浩孝	反応性プラズマの基礎
11	2000	2		中村 圭二	エッチングプラズマの気相反応過程
11	2000	3		中村 守孝	プラズマエッチングにおける表面反応
11	2000	4		寒川 誠二	無機系材料の反応性プラズマエッチング
11	2000	5		林 俊雄	NLDプラズマによるLow-kエッチング
11	2000	6		大森 達夫	無機系材料のスパッタエッチング
10	1999		11月19日()		
10	1999	1		篠原 俊二郎	RFによる高密度プラズマ生成
10	1999	2		佐々木 浩一	プラズマ診断法 一気相における荷電粒子、中性活性粒子計測
10	1999	3		南部 健一	プロセスプラズマとガス流れの粒子モデリング
10	1999	4		斧 高一	ドライエッチングにおける表面反応
10	1999	5		白藤 立	成膜プロセスにおける表面反応
9	1998		1月21日(木)、22日(金)		
9	1998	1		五味 秀樹	次世代デバイス用プラズマCVDプロセスの現状と課題
9	1998	2		宮武 浩	次世代デバイス用エッチングプロセスの課題
9	1998	3		真壁 利明	モデリング/シミュレーション
9	1998	4		渡辺 征夫	プラズマ装置におけるダスト発生とピュリフィケーション
9	1998	5		松田 彰久	アモルファスシリコン、微結晶シリコンの最近の話題
9	1998	6		藤山 寛	新しいプラズマプロセスとその応用
8	1997		10月30日、31日		
8	1997	1		菅井 秀郎	高密度プラズマ生成とアンテナ相互作用
8	1997	2		福山 淳	波動によるプラズマ生成のシミュレーション
8	1997	3		林 俊雄	高密度プラズマにおけるイオン種とイオンエネルギー分布
8	1997	4		辰巳 徹	高密度プラズマCVDの次世代LSI成膜プロセスへの応用
8	1997	5		関根 誠	0.15 μ m世代のエッチング技術ー課題とASETのチャレンジ
7	1996		11月14日(木)、15日(金)		
7	1996	1		真壁 利明	RFプラズマの放電基礎過程ー平行平板からICPまでー
7	1996	2		菅井 秀郎	プラズマ生成制御における磁場のメリットとデメリット
7	1996	3		堀 勝	高密度プラズマにおけるラジカル診断と制御ー気相から
7	1996	4		南部 健一	プラズマプロセスにおけるガス流れの構造と制御
7	1996	5		斧 高一	プラズマプロセスにおけるイオンとラジカルのエネルギーと
7	1996	6		寒川 誠二	パルス放電によるプラズマ状態の制御と高精度プラズマ
6	1995		11月16日、17日		
6	1995	1		佐藤 信安	連続体モデルによるプラズマシミュレーション
6	1995	2		北守 一隆	モンテカルロ法によるプラズマシミュレーション
6	1995	3		P. Ventzek	Hybrid model of inductively coupled plasma sources: Recer
6	1995	4		南部 健一	プラズマプロセスにおける希薄流のシミュレーション
6	1995	5		服藤 憲司	半導体ドライエッチング形状シミュレーション
6	1995	6		石谷 明彦	CVDおよび表面反応のモデリング
5	1994		11月17日、18日		
5	1994	1		雨宮 宏	プラズマ中シースの特性
5	1994	2		池川 正人	プラズマ構造シミュレーション
5	1994	3		橋 邦英	分光学的手法による気相・表面反応診断
5	1994	4		菅井 秀郎	質量分析法によるラジカル計測と表面反応
5	1994	5		藤原 伸夫	プラズマエッチングにおけるチャージアップの効果
5	1994	6		中村 守孝	ドライエッチングの表面反応過程
4	1993		11月18日、19日		
4	1993	1		三宅 正司	高密度プラズマ生成の基礎
4	1993	2		庄司 多津男	プラズマパラメータと波動の計測
4	1993	3		後藤 俊夫	分光法によるプラズマ中の中性活性種およびイオン種の計
4	1993	4		八坂 保能	高密度プラズマのモデリング
4	1993	5		斧 高一	プラズマプロセスにおけるシースの役割
4	1993	6		鈴木 敬三	プラズマプロセスの表面反応と技術開発の方向
3	1992		11月12日、13日		
3	1992	1		板谷 良平	新しいプラズマの発生法(概論)
3	1992	2		庄司 多津男	高密度ヘリコンプラズマの原理
3	1992	3		堀池 靖浩	磁化プラズマによるエッチング技術の最近の展開
3	1992	4		佐藤 徳芳	プラズマの構造制御と大面積化
3	1992	5		渡辺 征夫	プラズマCVDのダスト発生抑制法
3	1992	6		小田 俊理	VHFプラズマによるダメージフリープロセス
2	1991		11月20日、21日		

2	1991	1		雨宮 宏	プローブ計測法の実際と解析手法
2	1991	2		真壁 利明	時間分解発光分析法
2	1991	3		橘 邦英	レーザー分光計測法(可視, 紫外域)
2	1991	4		後藤 俊夫	レーザー分光計測法(赤外域)
2	1991	5		塚田 勉	電子, イオンのエネルギーと質量分析法
1	1990		10月5日、6日		
1	1990	1		渡辺 征夫	プロセス用反応性プラズマとは
1	1990	2		橘 邦英	反応性プラズマにおける原子分子基礎過程
1	1990	3		菅井 秀郎	プラズマの発生, 輸送, 維持機構
1	1990	4		松田 彰久	プラズマCVD
1	1990	5		細川 直吉	プラズマエッチング, スパッタリング
1	1990	6		真壁 利明	反応性プラズマのモデリング